

# 摩擦驅動致動器

## 本院覽號

02A-1000208

## 公告日期

## 智財權狀態

台灣(發明)I 436575已獲證、美國US 8,912,707 B2已獲證、中國CN102882421B / ZL 2012 1 0241765.5已獲證

## 摘要

一般長行程奈米級位移致動器之驅動機制複雜，無法輕易搭配市售或自製之線性位移平台。本技術之摩擦驅動模組具有體積小、安裝簡便之優點，可搭配市售之線性位移平台，創造出奈米級位移解析度之致動器。此致動器可多模式驅動，達到公分級位移以及次奈米級定位解析度。

## 技術優勢

目前市面上之線性、旋轉壓電致動器之驅動機制較複雜，本發明使用市售之積層式壓電材料，搭配市售或自行建構之位移平台，以簡單之摩擦驅動機制達成線性或旋轉之致動目的。

## 應用範圍

掃描探針顯微鏡樣品之大範圍與高解析調整。電子顯微鏡內部樣品位移與角度調整 光學鏡片線性、角度與旋轉致動。同步輻射X光顯微術之樣品旋轉平台 顯微鏡樣品台調整致動

## 創作人

胡恩德、廖先順、黃英碩



中央研究院  
ACADEMIA SINICA